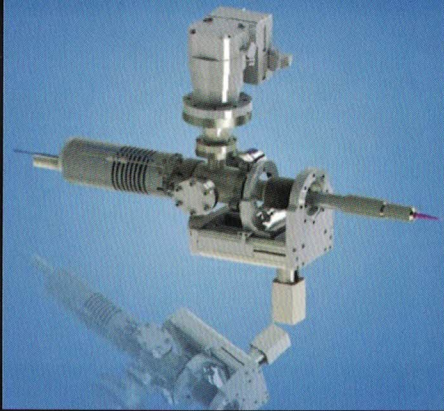
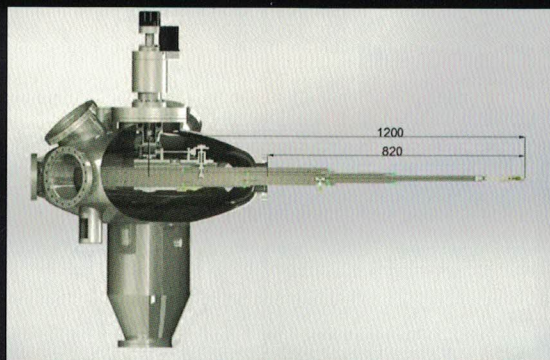




VUV光源

He、Ne、Ar、Kr、Xeなど様々なガス種で点灯可能な光源です。紫外線光電子分光、質量分析、吸収分光などの光源として利用可能です。上記の図は、差動排気により光源からのガスの流出を抑えた仕様のものであります。



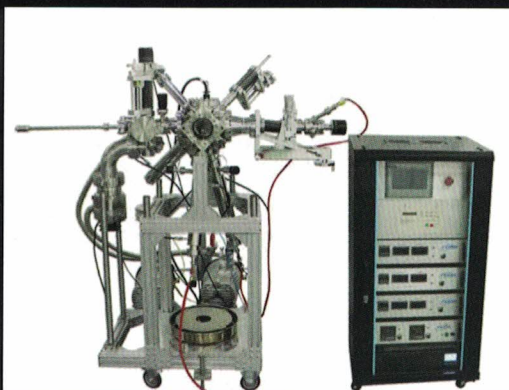
ラジアルトランスファーシステム

特徴的なUFO形状のチャンバーの中心を軸に、サンプル移送のためのロッドを回転させ、チャンバーのそれぞれのポートに接続した、分析機器などのチャンバーにサンプルを移送することが可能です。成膜や分析などに複数の装置を使用する場合に、それぞれの機器を接続し、試料を大気にさらすことなく真空中で移送が可能です。



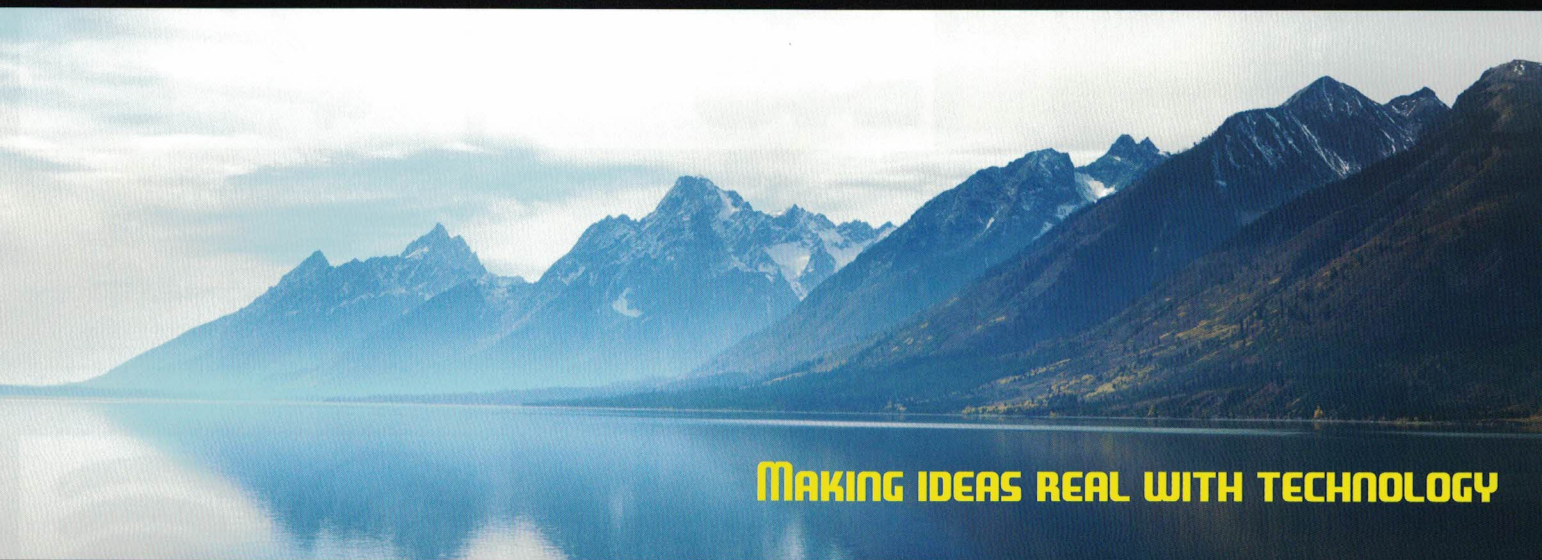
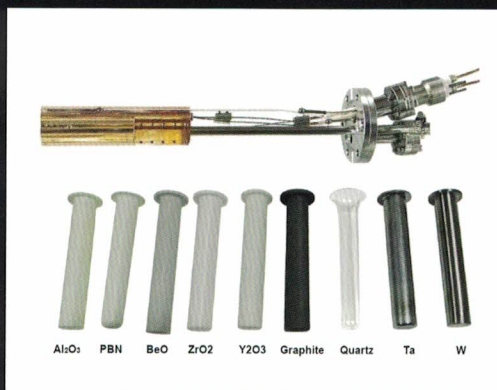
ヘリウム冷凍機

極低温まで冷却可能なリウム冷凍機です。液体ヘリウムを用いたフロータイプでは3Kまで、コンプレッサーを使用するクロードサイクルの場合は4.2Kまで冷却できます。放射光施設の実験用にも使用されている、試料の面内回転等が可能な多軸マニピュレーター付きです。



成膜装置、蒸着源

各種蒸着源、膜厚計、RHEEDなどを組み合わせた成膜装置を製作可能です。蒸着源単体での販売も可能です。



MAKING IDEAS REAL WITH TECHNOLOGY

SANKA High Technology

山佳ハイテクノロジー



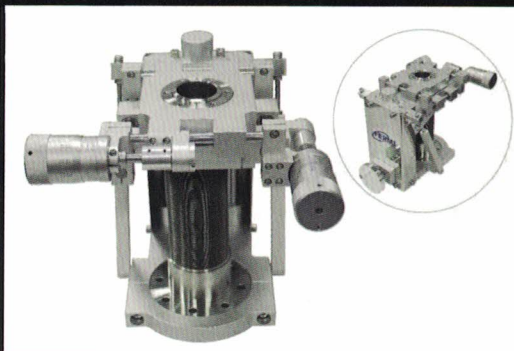
info@hightech.sanka-jp.com

<http://hightech.sanka-jp.com/>



回転導入機

ICF34、70に接続可能な小型の回転導入機（磁気カップリング方式、ベローズ式）や、大型のICF114、152、203フランジの貫通型のものがあります。圧空動作式、ステッピングモーター駆動にも対応可能です。



ステージ

溶接ベローズを使用した超高真空対応のステージです。ICF34の1軸の小型のものから、大型のXYZ 3軸のものまで様々な仕様のものがあります。詳細はお問い合わせください。



一体成型チャンバー

金属ブロックから切削加工で製作されたICFフランジ接続のチャンバーです。省スペースの真空チャンバーを構築できます。材質：SUS304、SUS316、SUS316L、Ti合金
到達真空：1E-8 Pa(1E-13 mbar)
最高ベーキング温度：250°C



ビューポートシャッター

蒸着用のチャンバー等で、蒸着時にビューポートへの材料の蒸着を防ぐ際に使用するシャッターです。ICF70、114、152、203フランジのものがあります。



トランスファーロッド

磁気カップリング式の直線回転導入機です。主に、試料の移送用に使われています。ICF34、ICF70フランジのものがあります。

真空機器設計製造メーカーと直接提携していますので、仕様の変更等の様々なご要望にも対応可能です。もし、お困りのことやご要望がございましたら、ぜひご相談ください。

詳細については、下記の弊社代理店にお問い合わせください。



上記以外にも、ICFフランジ用ガスケット（Cu、バイトン）、プレートナットなども取り扱っています。お気軽にお問い合わせください。